

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第1113號

上 訴 人 廣流智權有限公司

代 表 人 李文賢

訴訟代理人 蔡居諭 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 豪勉科技股份有限公司

代 表 人 彭以豪

訴訟代理人 李易撰 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年9月10日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）109年度行專訴字第15號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣參加人於民國102年10月17日以「能提昇檢測效率之點測方法」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共4項，經被上訴人編為第102137448號審查，准予專利，並發給發明第I541510號專利證書（下稱系爭專利）。後上訴人以系爭專利有違核准時專利法（下稱專利法）第22條第2項規定，對之提起舉發。經被上訴人審查，認系爭專利未違反前述專利法規定，以108年8月28日（108）智專三（二）04228字第10820822060號專利舉發審定書為「請求項1至4舉發不成

立」的處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願經決定駁回，循序提起本件行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷，命被上訴人就系爭專利為「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」之處分。經原審依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行專訴字第15號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：(一)系爭專利自承之先前技術、證據2及證據3皆無揭露系爭專利請求項1所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。系爭專利請求項1並非如證據3般每次下針進行點測程序時皆修正該次承載台之位移距離，此乃因為修正當次承載台位移距離需量測當次探針的壓力值，並將壓力值傳送至控制單元換算成位移值，再將位移值傳送至控制單元調整探針位移量，雖然能增加當次下針的精確度，但會拖慢整體量測效率，證據2根據第一次評價的探針高度位置將第二次及以後的探針高度位置調整至與第一次評價的高度位置相同的高度位置，如此便無須每次下針進行點測程序時皆需進行修正程序，然將每次下針皆固定探針高度位置必然造成探針位置精確度下降。系爭專利請求項1之技術手段為每次下針時皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時修正承載台位移距離的功效，故能同時兼顧精確度及檢測效率，因此系爭專利自承之先前技術、證據2及證據3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2說明書第[0030]段及圖1、2已揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7使附接到臂部3的探針2下降」之技術手段，系爭專利請求項3其他技術特徵之比對參照請求項1，故系爭專利自承之先前技術、證據2及證據3之組合不足以證明系爭專利請求項

3不具進步性。系爭專利請求項2為系爭專利請求項1之附屬項，因系爭專利自承之先前技術、證據2及證據3之組合不足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性，故亦無法證明其附屬項2、4不具進步性。上訴人主張證據2已揭示系爭專利「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵，且依證據2說明書段落[0042]記載可知，證據2先對全部200個電極之中前100個電極進行第1次評價，再依據第1次評價之探針高度位置，對剩下100個電極進行第2次評價，藉此完成同一片晶圓上數百至數千點的連續檢測，非如參加人所稱係對晶圓上所有晶粒重複作二次評價云云。惟查，證據2非如系爭專利請求項1係記錄當次下針的探針高度位置與第一次下針的探針高度位置的差值，再以該差值修正下一次下針的探針高度位置，因此證據2並無揭露系爭專利「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵，上訴人上開之主張，顯有誤解。(二)系爭專利自承之先前技術、證據2及證據4皆無揭露系爭專利請求項1所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。系爭專利請求項1因每次下針時皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時修正承載台位移距離的效果，因此系爭專利自承之先前技術、證據2及證據4之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2說明書第[0030]段及圖1、2已揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7使附接到臂部3的探針2下降」之技術手段；系爭專利請求項3其他技術特徵之比對請參照請求項1，故系爭專利自承之先前技術、證據2及證據4之組合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項2為系爭專利請求項1之附屬項，因

01 系爭專利自承之先前技術、證據2及證據4之組合不足以證明
02 系爭專利請求項1、3不具進步性，故亦無法證明其附屬項
03 2、4不具進步性。上訴人主張系爭專利申請專利範圍並無限
04 定晶圓不平整所致差異位移值，探針位移偏差係由諸多因素
05 所致綜合結果，證據4已揭示條件改變包含「晶圓不平整」
06 云云。惟查，根據上述證據4第7至10頁之記載，無論導致晶
07 圓不平整的原因為何，證據4揭露之檢測方法皆是根據最後
08 測量之經過時間及/或特定元件之溫度改變決定要不要重新
09 量測探針偏移量並校正，而每輪檢測會下複數次探針而無須
10 校正，因此無論需校正探針位置的原因為何，證據4並未將
11 每次下針時探針位置與理想位置的差異值回傳給系統用以調
12 整下一次下針時的探針位置，故並無揭露系爭專利請求項1
13 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點
14 測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵。(三)系爭
15 專利自承先前技術、證據2與證據3之組合不足以證明系爭專
16 利請求項1-4不具進步性，已如前述；系爭專利自承先前技
17 術、證據2與證據4之組合不足以證明系爭專利請求項1-4不
18 具進步性，已如前述；因系爭專利自承先前技術、證據2、
19 證據3與證據4皆未揭露系爭專利請求項1之「使該驅動裝置
20 能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動
21 該承載台之位移距離」技術特徵，故系爭專利自承先前技
22 術、證據2、證據3與證據4之組合不足以證明系爭專利請求
23 項1-4不具進步性。(四)系爭專利自承之先前技術、證據2及證
24 據5皆無揭露系爭專利請求項1所述「使該驅動裝置能根據該
25 差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台
26 之位移距離」之技術特徵。系爭專利請求項1因每次下針時
27 皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針
28 的承載台位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測
29 卻又能即時修正承載台位移距離的效果，具有不可預期之功效，故系爭專利自承之先前技術、證據2及證據5之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2說明書第[0030]

01 段及圖1、2已揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測
02 裝置7使附接到臂部3的探針2下降」之技術手段；系爭專利
03 請求項3其他技術特徵之比對請參照請求項1，故系爭專利自
04 承之先前技術、證據2及證據5之組合不足以證明系爭專利請
05 求項3不具進步性。系爭專利請求項2為系爭專利請求項1之
06 附屬項，因系爭專利自承之先前技術、證據2及證據5之組合
07 不足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性，故亦無法證明
08 其附屬項2、4不具進步性。上訴人主張甲證3-1（即證據5的
09 美國對應案）可佐證證據5說明書第20頁末行至第21頁第4行
10 已揭露將用於第一被檢查體W' 主夾具(11)的下降或上升距離
11 設置為用於第二或後續被W' 檢查體云云。惟查，該段落揭露
12 之技術手段係直接將第二或後續檢測時的主夾具下降或上升
13 距離設置為與第一次檢測時相同，而非根據第二次檢測與第
14 一次檢測的主夾具下降或上升距離差值去調整第三次檢測的
15 主夾具下降或上升距離，無論證據5或甲證3-1皆未揭露系爭
16 專利請求項1之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整
17 下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術
18 特徵。(五)系爭專利自承之先前技術、證據2及證據6皆無揭露
19 系爭專利請求項1所述「使該驅動裝置能根據該差異位移
20 值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距
21 離」之技術特徵。系爭專利請求項1因每次下針時皆會記錄
22 差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台
23 位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即
24 時修正承載台位移距離的效果，具有不可預期之功效，故系
25 爭專利自承之先前技術、證據2及證據6之組合不足以證明系
26 爭專利請求項1不具進步性。證據2說明書第[0030]段及圖
27 1、2已揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7
28 使附接到臂部3的探針2下降」之技術手段；系爭專利請求項
29 3其他技術特徵之比對請參照請求項1，故系爭專利自承之先
30 前技術、證據2及證據6之組合不足以證明系爭專利請求項3
31 不具進步性。系爭專利請求項2為系爭專利請求項1之附屬

項，因系爭專利自承之先前技術、證據2及證據6之組合不足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性，故亦無法證明其附屬項2、4不具進步性。(六)原處分已針對上訴人提出之論點進行回應說明，並無上訴人所稱漏未斟酌其全部陳述，違反行政程序法第9、36、43條規定情事。且審定書所載「……因晶圓不平整而導致探針壓力不同而校正探針位移距離……」，僅是用以瞭解系爭專利發明之目的、作用及效果，並未將其讀入系爭專利申請專利範圍，而增加申請專利範圍所無限制，上訴人稱原處分違反核准時專利法第58條第4項規定云云，亦無可採等語。

四、上訴人上訴意旨略以：(一)系爭專利僅要求對下一次點測程序進行調整，並未要求循環上述修正步驟，亦未要求每一次點測程序承載台(或探針)的移動量皆必須根據上一次的移動量及壓力量測結果作修正。然原判決誤認系爭專利請求項1之技術手段為每次下針時皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位移距離，顯係基於錯誤的申請專利範圍解釋所作成，違反專利法第58條第4項規定。(二)原處分既已肯認證據2說明書第[0038]、[0039]段揭示系爭專利「比對該實際位移值及該理想位移值，且獲得該實際位移值及該理想位移值間之一差異位移值」及「第2次評價的下針高度係基於第1次評價的下針高度來調整」之技術特徵，則本發明所屬技術領域中具有通常知識根據上述教示能輕易完成「將第2次評價時所獲得的差異位移值用來調整在第3次評價時的下針高度」之技術特徵。然原處分過度機械性地比對差異，僅僵化強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等而忽略系爭專利之發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者所「能輕易完成」此一要件，違反專利法第22條第2項及本院105年度判字第503號判決意旨，訴願決定及原判決予以維持顯有違誤。(三)原處分對於證據2說明書第[0042]段之記載、晶圓測試技術領域通常知識及上訴人面詢意見陳述等有利上訴人之證據，均無調查審究，亦未

載明任何論駁理由，顯漏未斟酌上訴人全部陳述並說明理由，違反行政程序法第9、36、43條規定；又引證文件所揭露之技術內容包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，然原判決將證據2所揭露之技術內容侷限於形式上明確記載的內容，逕認證據2與其他證據之組合不足以證明系爭專利不具進步性，違反論理及經驗法則。是原判決未斟酌全辯論意旨及調查證據結果構成理由不備之違法。(四)系爭專利自承先前技術、證據2與證據3同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC均為G01R，技術領域具有關聯性；系爭專利自承先前技術、證據2與證據3均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性；系爭專利自承先前技術、證據2與證據3均是透過調整探針與待測裝置之間的相對關係來進行校正，功能或作用具有共通性。準此，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2與證據3予以組合。是系爭專利自承先前技術、證據2及證據3之組合足證系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利自承先前技術第[003]段及圖1已揭示系爭專利請求項3之技術特徵，則系爭專利自承先前技術、證據2及證據3之組合足證請求項3不具進步性。又系爭專利請求項2、4依附於請求項1、3，請求項1、3不具進步性已如前述，則系爭專利自承先前技術、證據2及證據3之組合足證系爭專利請求項2、4不具進步性。綜上，系爭專利自承先前技術、證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性。(五)系爭專利自承先前技術、證據2與證據4同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC均為G01R，技術領域具有關聯性；系爭專利自承先前技術、證據2與證據4均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性；系爭專利自承先前技術、證據2與證據4均是透過調整探針與待測裝置之間的相對關係來進行校正，功能或

作用具有共通性。準此，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2與證據4予以組合。是系爭專利自承先前技術、證據2及證據4之組合足證系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利自承先前技術第[003]段及圖1已揭示系爭專利請求項3之技術特徵，則系爭專利自承先前技術、證據2及證據4之組合足證請求項3不具進步性。又系爭專利請求項2、4依附於請求項1、3，請求項1、3不具進步性已如前述，則系爭專利自承先前技術、證據2及證據4之組合足證系爭專利請求項2、4不具進步性。綜上，系爭專利自承先前技術、證據2及證據4之組合足證系爭專利請求項1至4不具進步性。(六)系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC均為G01R，技術領域具有關聯性；系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性；系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4均是透過調整探針與待測裝置之間的相對關係來進行校正，功能或作用具有共通性。準此，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4予以組合。是系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4之組合足證系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利自承先前技術第[003]段及圖1已揭示系爭專利請求項3之技術特徵，則系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4之組合足證請求項3不具進步性。又系爭專利請求項2、4依附於請求項1、3，請求項1、3不具進步性已如前述，則系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4之組合足證系爭專利請求項2、4不具進步性。綜上，系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4之組合足證系爭專利請求項1至4不具進步性。(七)系爭專利自承先前技術、證據2與證據5同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC均為G01R，技術領域具有關聯性；系爭專利自承

01 先前技術、證據2與證據5均是解決探針與待測物之間位移不
02 均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所
03 欲解決的問題具有共通性；系爭專利自承先前技術、證據2
04 與證據5均是透過調整探針與待測裝置之間的相對關係來進
05 行校正，功能或作用具有共通性。準此，所屬技術領域中具
06 有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據
07 2及證據5予以組合。是系爭專利自承先前技術、證據2及證
08 據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又先前技
09 術第[003]段及圖1已揭示系爭專利請求項3之技術特徵，則
10 系爭專利自承先前技術、證據2及證據5之組合足證請求項3
11 不具進步性。又系爭專利請求項2、4依附於請求項1、3，請
12 求項1、3不具進步性已如前述，則系爭專利自承先前技術、
13 證據2及證據5之組合足證系爭專利請求項2、4不具進步性。
14 綜上，系爭專利自承先前技術、證據2及證據5之組合足證系
15 爭專利請求項1至4不具進步性。(八)系爭專利自承先前技術、
16 證據2與證據6同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IP
17 C均為G01R，技術領域具有關聯性；系爭專利自承先前技
18 術、證據2與證據6均是解決探針與待測物之間位移不均，導
19 致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決
20 的問題具有共通性；系爭專利自承先前技術、證據2與證據6
21 均是透過調整探針與待測裝置之間的相對關係來進行校正，
22 功能或作用具有共通性。準此，所屬技術領域中具有通常知
23 識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2與證據6
24 予以組合。是系爭專利自承先前技術、證據2及證據6之組合
25 足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又先前技術第[003]
26 段及圖1已揭示系爭專利請求項3之技術特徵，則系爭專利自
27 承先前技術、證據2及證據6之組合足證請求項3不具進步
28 性。又系爭專利請求項2、4依附於請求項1、3，請求項1、3
29 不具進步性已如前述，則系爭專利自承先前技術、證據2及
30 證據6之組合足證系爭專利請求項2、4不具進步性。綜上，

01 系爭專利自承先前技術、證據2及證據6之組合足證系爭專利
02 請求項1至4不具進步性。

03 五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，於法並無違誤。茲
04 就上訴意旨補充論斷如下：

05 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
06 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。系爭專利於102年
07 10月17日申請，經被上訴人進行審查，於105年5月31日審定
08 准予專利，故其是否符合專利要件，應以核准審定時即103
09 年1月22日修正公布、103年3月24日施行之專利法為斷。次
10 按，利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用
11 者，得依法申請取得發明專利，為核准審定時專利法第22條
12 第1項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通
13 常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得
14 發明專利，復為同法第22條第2項所明定。而發明專利權違
15 反上開專利法之規定者，依同法第71條第1項第1款、第73條
16 第1項規定，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉
17 發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其
18 發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

19 (二)關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，
20 就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審
21 酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。經查上
22 訴人係專利舉發案之舉發人，原舉發主張證據2至4及其組合
23 足以證明參加人所有之系爭專利請求項1至4不具進步性，其
24 於舉發不成立後提起本件行政訴訟，並針對原舉發理由補充
25 提出證據5、6及證據2、5之組合、證據2、6之組合等新證
26 據。被上訴人於原處分中雖未及審究前述新證據，惟經原審
27 給予相當準備時間就此表明其意見，被上訴人、參加人亦就
28 此部分詳為答辯，不致造成突襲。是前揭新證據部分，核係
29 就同一撤銷理由提出之新證據，依上開規定，原審得予以審
30 酌。

01 (三)發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範
02 圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第58條第4
03 項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此
04 解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說
05 明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。經查：

06 1. 系爭專利係一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一
07 點測機台上，該點測機台包括一承載台、一治具及一控制
08 單元，該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝置；該承
09 載台上置放有複數個待測元件(如：LED之晶粒)，且能被
10 一驅動裝置帶動進行上下位移，使該待測元件與該點測探
11 針相接觸；該控制單元係分別與該驅動裝置及該治具相電
12 氣連接，該點測方法能使該控制單元透過該驅動裝置，令
13 該承載台朝上位移，且在該點測探針接觸到該待測元件
14 時，接收由該壓力感測裝置傳來之一偵測訊號；之後，將
15 該偵測訊號換算為一實際位移值，並將該實際位移值與一
16 理想位移值進行比對，以獲得一差異位移值；最後，將該
17 差異位移值傳送予該驅動裝置，如此，由於該點測方法係
18 直接控制驅動裝置之位移距離，故能確保點測程序之速度
19 與穩定性，提昇點測程序之效率(系爭專利摘要，見乙證2
20 第179頁)。

21 2. 系爭專利請求項1記載之點測方法，在進行點測步驟時，
22 「比對該實際位移值及該理想位移值，且獲得該實際位移
23 值及該理想位移值間之一差異位移值；及將該差異位移值
24 傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，
25 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距
26 離。」(見乙證2第225頁)。亦即，系爭專利請求項1已
27 界定當次進行點測步驟得到之差異位移值會影響下一次進
28 行點測時之承載台的移動距離。

29 3. 系爭專利說明書第[0020]段記載：「有鑑於相鄰的待測單
30 元L或承載台21表面位置狀態可能較為接近」(見乙證2第
31 171頁)，第[0023]段記載「……一般言，點測探針會在

晶圓上方來回移動，以逐一測試所有的晶粒，且由於晶圓的厚度並非完全相同，因此若以習知的點測方法進行點測……針壓變動度高達50mW(約在90~150微伏特之間)；……藉由本發明之點測方法，由於點測探針將能自行調校，故針壓即能自行適應性地調校，讓針壓的變動幅度始終保持20mW(約在10~30微伏特之間)內」(見乙證2第170頁)，故系爭專利能達成說明書第[0008]、[0009]段所記載避免該待測元件受到損傷，令該點測程序的效率大幅提升之發明目的。

4. 如此每次點測時皆會依據位置相鄰之前一次待測元件點測得到之差異位移值來進行調整，故系爭專利請求項1已明確界定進行點測步驟與上一次點測步驟具關聯性，並據此達成發明目的。上訴意旨以其主觀見解主張原判決有錯誤解釋系爭專利範圍之違法云云，並非可採。

(四)又，證據2說明書第[0038]段之中文譯文為：「此外，當在同一半導體晶圓之電性評價需重複至少2次時，第1次評價係根據所偵測到之探針與電極之間的接觸量來調整探針的高度位置。在第2次及以後的評價係可根據第1次評價所調整的探針高度為基礎來調整探針高度。」(見乙證1第69頁反面)。亦即第2次到第N次的評價(包含第3次評價)，皆係根據「第1次」評價所調整的探針高度為基礎來調整探針高度。系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者，自然無法由證據2輕易完成「將第2次評價時所獲得的差異位移值用來調整在第3次評價時的下針高度」。上訴意旨以：何以通常知識者依證據2教示無法輕易完成「將第2次評價時所獲得的差異位移值用來調整在第3次評價時的下針高度」？並據以指摘原判決對於進步性之比對僵化，違反專利法第22條第2項進步性比對規定云云，尚有誤會。

(五)又，所謂判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。經查：

- 01 1. 證據2說明書第[0040]～[0045]段記載實施例對200個電極
02 中的100個電極進行第1次GOI評價，再依據第一次評價中
03 調整的探針高度位置，剩餘的100個電極以同樣方式進行G
04 OI評價（見乙證1第68頁）。亦即，證據2第[0042]段實施
05 例與前述證據2說明書第[0038]段技術方案為相同，第2次
06 到第N次的評價（包含第3次評價），皆係根據「第1次」
07 評價所調整的探針高度為基礎來調整探針高度，並無法達
08 成系爭專利之發明目的。
- 09 2. 原判決已說明「根據上述證據2第[0038]、[0039] 及[004
10 2] 段之記載，其係記錄第一次評價的探針高度位置，並
11 將第二次及以後的探針高度位置調整至與第一次評價的高
12 度位置相同的高度位置，證據2所述『第一次評價』與
13 『第二次評價』係指進行待測物檢測程序時下針的時序關
14 係，『第一次評價』泛指下針時序較早的點測程序，『第
15 二次評價』泛指下針時序較晚的點測程序，因此無論是採
16 『檢測待測物上複數點』或是『單一點檢測複數次』的見
17 解，對解讀證據2的技術手段並無影響。證據2非如系爭專
18 利請求項1係記錄當次下針的探針高度位置與第一次下針
19 的探針高度位置的差值，再以該差值修正下一次下針的探
20 針高度位置，因此證據2並無揭露系爭專利『將該差異位
21 移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移
22 值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移
23 距離』之技術特徵」（見原判決第40頁第3行至第17
24 行）、「證據2在第一次的評價時係使用與系爭專利自承
25 先前技術相似的技術手段，先檢測出探針和電極的接觸
26 量，然後基於所檢測出的探針和電極的接觸量調整探針的
27 高度位置，第二次及以後的評價則可根據於第一次評價時
28 所調整的探針高度來調整探針高度。因此證據2決定探針
29 高度位置的方法只有兩種：一種是根據壓力值調整當次探
30 針高度位置；一種是將探針高度位置直接設定為一固定
31 值，而系爭專利請求項1採取的是一種動態的探針高度位

置修正方法，其係根據第一次的下針位置決定當次的下針位置，再根據壓力值換算出的位移差異修正下一次的下針位置，證據2除並無揭露『使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離』之技術特徵外，該技術領域中具有通常知識者亦無法輕易由證據2揭露的兩種決定探針位置的方法得知上述系爭專利請求項1之技術特徵。」（見原判決第40頁第19行至第41頁第6行）。

3. 綜上，上訴人以其對證據2之錯誤理解，指摘原判決就證據2之論述違反論理及經驗法則、未斟酌全辯論意旨及調查證據結果，判決不備理由云云，並非可採。

(六) 至於上訴人上訴理由狀第10頁至第44頁所列系爭專利不具進步性之主張，經核僅係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，並未具體指摘原判決有何違背法令，亦非可採。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 6 月 9 日

最高行政法院第二庭

審判長法官 帥 嘉 寶

法官 鄭 小 康

法官 林 玫 君

法官 李 玉 卿

法官 洪 慕 芳

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 6 月 9 日

書記官 張 玉 純